Elektronowa mikroskopia skaningowa ze zmienną próżnią

Principles and Practice of Variable Pressure/Environmental Scanning Electron Microscopy

Debbie Stokes, John Wiley & Sons, 2008

 LV-SEM – Low Vacuum Scanning Electron Microscope Ciśnienie gazu od 0 tora do 1 tora (0 mbara do 1.33 mbara)
 E-SEM – Environmental Scanning Electron Microscope Ciśnienie gazu od 1 do 20 torów (1.33 mbara – 26.6 mbara)

• VP-SEM – Variable Pressure Scanning Electron Microscope

Ciśnienie gazu od 0 do 26.6 mbara

Table 5.1. Basic Gas Pressure Definitions

1 atm = 760 mm Hg = 1 bar 1 torr = 1 mm Hg 1 torr = 133 pascal (Pa) = 1/760 atm 1 mbar = 1/1000 atm = 0.76 torr = 100 Pa



Pumping system of ESEM

Emission area: min. 10⁻⁵ Torr



FIRST NAME IN MICROAN

Detektor GSED (gaseous secondary electron detector)



Niska próżnia

 $e^- + H_2O \rightarrow H_2O^+ + 2 e^-$

 $e^{-} + H_2O \rightarrow H_2O^* + e^{-}$

Molekuły H₂O rozpadają się na wolne rodniki lub jony

 $H_2O^* + e^- \rightarrow H^{\bullet} + OH$

 $H_2O^* + e^- \rightarrow H^+ + OH^-$



Brak przewodnictwa elektrycznego "Skirt effect"



Brak przewodnictwa elektrycznego "Skirt effect"



Przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne



Rozpraszanie poza wiązką

 $-\sigma Pd/RT$ e

f - liczba elektronów w wiązce:
σ - przekrój czynny na rozpraszanie
P - ciśnienie
d - odległość: PLA - powierzchnia próbki (GPL)
R - stała gazowa



T - temperatura

Aby ograniczyć "skirt effect"

- Możliwie najniższe ciśnienie gazu (optymalnie 0.2 0.3 tora)!
- Najmniejsza odległość: PLA próbka (ograniczenie drogi elektronów w gazie)!
- •Stosowanie wysokich energii elektronów wiązki!
- **Obrazowanie:**
 - Nie wpływa na obraz: "skirt" dodaje prawie równomierne tło
 - Zdolność rozdzielcza określona jest przez średnicę wiązki elektronowej

Wzmocnienie kaskadowe





Wzmocnienie kaskadowe

 Wzmocnienie sygnału G rośnie z odległością d od próbki:

$$G = e^{\alpha d}$$

oraz z "wydajnością wzmocnienia" *a*

$$\alpha = APe^{-BPd/V_0}$$

gdzie: P – ciśnienie gazu, V_0 – przyłożone napięcie do detektora, and A & B – stałe zależne od rodzaju gazu



Przy niskich ciśnieniach gazu – pojedyncze jonizacje – słabe wzmocnienie sygnału Przy wysokich ciśnieniach gazu – lawina jonizacji – nieelastyczne rozpraszanie powoduje wytracanie energii elektronów co redukuje prawdopodobieństwo jonizacji

Wzmocnienie kaskadowe



Maximum sygnału przy wyższych ciśnieniach – dodatkowa jonizacja molekuł przez elektrony wiązki (PE)



Całkowity sygnał kaskady

$$I_{c} = I_{o} \exp^{\alpha d} \left\{ \delta + \frac{S_{PE}}{\alpha d} + \eta \frac{S_{BSE}}{\alpha d} \right\}$$

gdzie:

S_{PE} – wydajność jonizacji elektronów pierwotnych

 S_{BSE} – wydajność jonizacji elektronów wstecznie rozproszonych

- δ współczynnik emisji elektronów wtórnych
- η współczynnik emisji elektronów wstecznie rozproszonych
- I_o prąd wiązki elektronowej
- I_c prąd zarejestrowany przez detektor
- a wydajność wzmocnienia
- d odległość detektor-próbka

Który gaz jest najlepszy?



Siatka Cu na C



Wzmocnienie kaskadowe

- Wzmocnienie kaskadowe zależy od
 - Ciśnienia gazu
 - Napięcia przyłożonego od detektora
 - Working distance WD/gas path length GPL

Rodzaju gazu Primary electron scattering - definition of WD, d and GPL



	C	Objective lens poler	piece	
Gas lengtr Working distance WD	Pressure limiting (path GPL Gas path length GPL	differential) apertur On-axis specimen- detector distance <i>d</i>	Extended pressur limiting (differentia aperture Gas path length GPL	re al) Off-axis specimen- detector distance d







Figure 4.12 Backscattered electron images to show the effect of (a) short working distance, short gas path length (3 mm), (b) long working distance, long gas path length (10.5 mm) and (c) long working distance (10.5 mm), short gas path length (3 mm). Notice how in (c) the contrast and signal-to-noise have improved. Imaged in nitrogen gas with primary beam energy $E_0 = 20$ keV. Horizontal field width = 255 µm. Images courtesy of Ken Robinson, Carl Zeiss SMT Ltd





Mikroanaliza:

Analiza ilościowa trudna ale możliwa (stosowanie procedur korekcyjnych) Mapping możliwy ale sygnał jest rejestrowany w większych obszarów niż rzeczywistości

X-ray Mapping: Cement

Suchy

Mokry



Duża próbka w homogenicznej matrycy

Próbka: Jadeit

NaAlSi₂O₆ - krzemian sodu i glinu, niekiedy zawiera domieszkę wapniowomagnezowego diopsydu.

Matryca 1: polimer — Matryca 2: blok Cu/Zn

Odległość między punktem centralnym a blokiem Cu/Zn > 500 micron



VP – Variable Pressure – technika kompensacji wpływu gazu mierzymy dwa widma przy różnych ciśnieniach gazu

Widmo jadeitu w HV SEM 25kV



Brak pików Cu i Zn

Beam stop method (Bilde-Sorensen) Zbieramy dwa widma: jedno przy LV, drugie – przy zablokowanej wiązce np. igła nad próbką

PVM pressure variation method gas compensated technique (2 widma EDX zmierzone przy dwóch różnych ciśnieniach, intensywności pików interpolowane do zera (R.Gauvin)

Pressure variation method



Wyższe ciśnienie: więcej kwantów X z B, mniej z A

Pressure variation method

Intensity



Dwa pomiary przy dwóch różnych ciśnieniach

Ekstrapolowanie intensywności poszczególnych pików do O

Zastosuj odpowiednią korecję do ekstrapolowanych wartości aby otrzymać ilościową informację o składzie chemicznym

Widmo jadeitu w niskiej próżni (0.3 tora) 25kV

×	low vacuum 0.4		14:07:15	
	Oxide:	Net	₩t%	At%
	Na2O	72.65	13.85	15.19
	MgO	6.94	1.31	2.21
	AI203	157.43	25.04	16.69
	SiO2	294.65	53.70	60.71
	CaO	6.77	0.68	0.83
	Fe203	2.48	0.46	0.20
	CuO	11.30	2.96	2.53
	ZnO	6.49	1.98	1.65
	Total		100.00	100.00

Pojawiają się niewielkie piki pochodzące od matrycy 2 Cu/Zn

Widmo jadeitu w niskiej próżni (0.6 tora) 25kV



Duże piki pochodzące od matrycy 2 Cu/Zn

Wyniki analizy

				-					
				corrected		14:08:31			
				Oxide:	Net	₩t%	At%		
				Na2O	78.35	14.33	15.58		
				MgO	7.32	1.33	2.23		
Niska próżnia			AI203	168.07	26.12	17.27			
			SiO2	308.47	56.83	63.70			
(0.2 - 0.4 Torr)			CaO	6.99	0.74	0.8			
			Fe2O3	3.18	0.64	0.27			
			CuO	0.00	0.00	0.00			
				ZnO	0.00	0.00	0.00		
		10 50 40							
nigh vacuum		13:58:42		Total		100.00	100.00		
Uxide:	Net	₩t%	At%						
Na2O	79.51	14.27	15.51						
MgO	6.47	1.15	1.93						
AI203	171.49	26.08	17.24	próżnia					
SiO2	317.12	57.21	64.17						
CaO	7.39	0.77	0.93						
Fe203	2.66	0.52	0.22		—				
Total		180.90	100.00						

Wyniki analizy w niskiej próżni są zbliżone do uzyskanych w HV

Aby zredukować zjawisko "skirt effect" należy użyć:

- Minimalną GPL
- Wysokie napięcie przyspieszające w SEM (np. 25kV)
- Niską próżnię (0.1 0.3 mbar)





WAX-ray

GAD - BSE

Jak sprawdzić czy ładunek elektryczny zgromadzony w próbce jest skompensowany?



Granica Duane-Hunta – przy jakiej energii kończy się widmo ciągłe?

$$\mathbf{V}_{s} = (\mathbf{E}_{L} - \mathbf{E}_{0}) / \mathbf{e}$$

 $E_0 = 20 \text{ keV}$ $E_L = 20.5 \text{ keV}$ $V_S = +500 \text{ eV}$ Minimalne ciśnienie, które utrzymuje wodę w fazie ciekłej: 4.6 tora przy temp. 0°C. Wyższe temperatury wymagają wyższego ciśnienia



Płatek orchidei

Zwilżanie polistyrenu



Zwilżanie SiO₂



EBSD z materiałów nieprzewodzących



Brak kompensacji ładunku – niszczenie katastroficzne w ceramice PLZT ulegającej spontanicznej polaryzacji





Wpływ warstwy napylanej na jakość dyfrakcji (monokryształ NiO) a) brak napylania, b) napylanie węglem, c) napylanie złotem





Szereg zmiennych, m.in.:

- Rodzaj gazu
- Ciśnienie gazu
- Odległości GPL (Gas Path Length)
- Energia elektronów wiązki

Przekrój czynny na rozpraszanie elastyczne



Należy stosować: a) jak najniższe ciśnienie gazu, b) jak najmniejszą odległość GPL (Gas Path Length)



Wpływ ciśnienia gazu na jakość dyfrakcji a) 0.05 tora, b) 0.5 tora, c) 1.0 tora



$\begin{array}{c} \textbf{Ceramika PLZT} \\ Pb_{1-3x/2}La_{x}Zr_{0.65}Ti_{0.35}O_{3} \ dla \ x = 0.08 \\ (PLZT \ 8/65/35) \end{array}$

91% rozwiązanych dyfrakcji



IPF – ziarna przypadkowo zorientowane





Mapy orientacji otrzymane dla nieprzewodzącego ZrO₂ o symetrii regularnej



a) C-SEM nieskompensowany ładunek elektryczny

b) VP-SEM skompensowany ładunek elektryczny



 Al_2O_3 (cisnienie $H_2O - 0.4 \text{ mbar}$)



 Al_2O_3 (cisnienie $H_2O - 1.33$ mbar)

Gdy ciśnienie gazu jest za niskie....



gruboziarnisty Al₂O₃

drobnoziarnisty Al₂O₃

Gdy ciśnienie jest za niskie w LV-SEM: ładunek elektryczny nie jest całkowicie skompensowany